

オートフォーカス段差測定器

DM250

大型試料対応非接触段差測定顕微鏡

現品限りのディスカウント!

非接触で0.1 μ mの測定分解能

鏡面試料でもワンタッチで高速測定

モータードライブ 大型XYステージ搭載

DM250はオートフォーカス方式の非接触段差測定器です。独自のターゲットマーク投影光学系、スプリットイメージ光学系およびAFシステムにより高精度な段差測定ができます。変形や打痕の心配なく各種半導体、MEMSデバイス、精密加工部品等、幅広くご使用頂けます。



【特徴】

- ◆ 光学的観察による非接触高精度測定
- ◆ スプリットイメージ光学系+AFIによる焦点合わせ
- ◆ 鏡面試料にも対応するパターン投影システム
- ◆ 試料表面を接眼レンズ、モニターで観察しながら段差測定
- ◆ レボルバ式対物レンズ倍率切替 (5 \times 、10 \times 、40 \times)
- ◆ X軸ストローク250mm 大型モータードライブステージ
- ◆ 安定した測定ができる石製定盤装備
- ◆ プリセット式2段照明光量切替

鏡筒タイプ	三眼鏡筒(正立像:Cマウント付)	フォーカス駆動方式	パルスモータードライブ、手動(微動、粗動)
照明方式	同軸落射照明	移動分解能	0.1 μ m
接眼レンズ	NWF10 \times (15 \times はオプション)	測定分解能	3.3 μ m(5 \times)、1.67 μ m(10 \times)、0.67 μ m(40 \times)
対物レンズ	PLM5 \times 、PLM10 \times 、PLLWDM40 \times	計測方式	リニアスケール
実視野	ϕ 3.2、 ϕ 1.6、 ϕ 0.4 mm	フォーカス合わせ	スプリットイメージ+AF
ステージ駆動方式	パルスモータードライブ	プリサイズパターン	黒線、白抜き、無し 3段切替
X軸ストローク	250mm(\pm 125mm)	照明光源	ハロゲンランプ+ライトガイドファイバー
Y軸ストローク	100mm(\pm 50mm)	本体ベース	石定盤
スピードプリセット	4段階およびステップ送りモード	寸法/重量	1600(H) \times 920(W) \times 700(D)mm、300Kg
移動分解能	1 μ m	ユーティリティ	電源 AC100V 10A 以下

(改良のため仕様・意匠は変更されることがあります)



株式会社 ナノテック
Nanometric Technology Inc.

www.nanotech-inc.co.jp info@nanotech-inc.co.jp

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201 電話 03(3960)3171 Fax 03(3960)3174